



凍結マイクローム切断した樹脂断面のULV-SEM観察

最先端の物理解析手法を駆使し、お客様のニーズにお応えします。

試料の極表面や断面をナノ以下のスケールで観察・分析するには、加工によるダメージや汚染のない試料作製技術が不可欠です。極低加速電圧走査型電子顕微鏡(ULV-SEM)や収差補正走査型透過電子顕微鏡(Cs-STEM)で培った試料作製技術を駆使し、最適な方法で試料加工し、観察に供します。

極低加速電圧走査型電子顕微鏡(ULV-SEM)の特徴

● 装置

ZEISS社製ULV-SEM ULTRA55

- ・ サーマサイエンティフィック社製EDS

● 特徴

- 極表面構造観察 絶縁物の無処理観察
- 極表面組成コントラスト・状態コントラスト
- 極低加速電圧における超高分解能
(4.0nm:100V,1.7nm:1kV)
- 超高分解能EDX分析(最小31nm)
- 超高分解能粒子解析

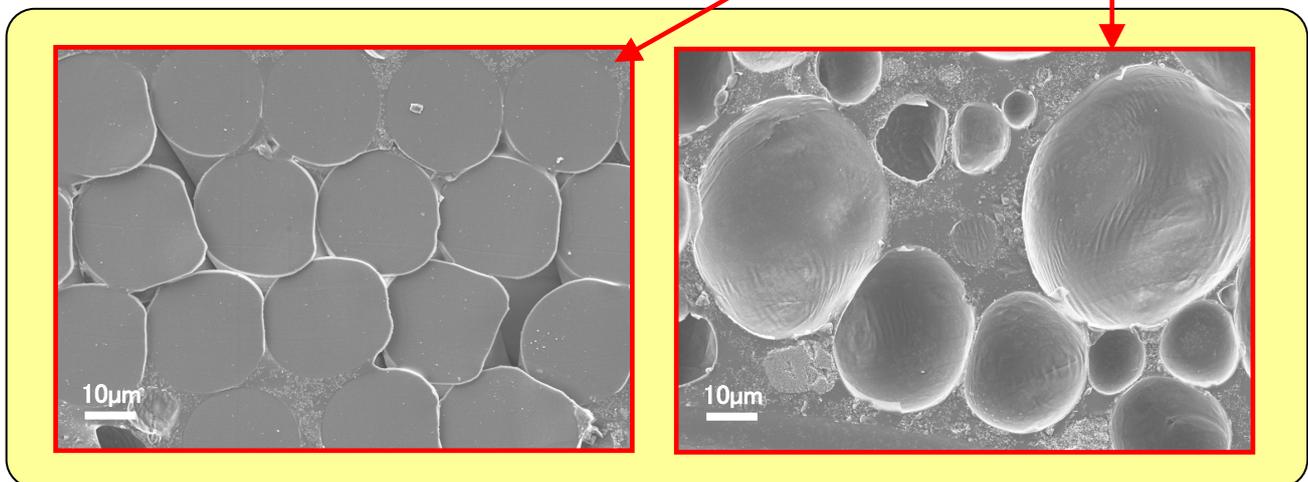
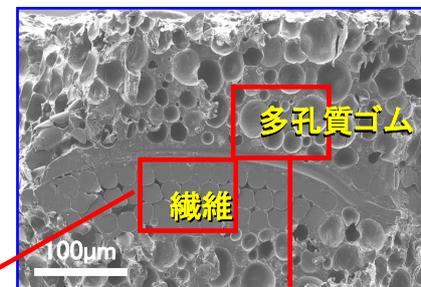


ZEISS製ULV-SEM ULTRA55

樹脂断面のULV-SEM観察例

● 凍結マイクローム切断した繊維含有ゴムシート断面の観察

凍結マイクローム技術により、繊維と多孔質ゴム複合材の平坦な切断が可能となります。ULV-SEMの低加速電圧観察と合わせて、ゴム中の繊維と空孔の状態を明瞭に観察することができます。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

☎ 0120-643-777

Copyright ©2012 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。